The 38th Annual Confernce on Magnetics in Japan Session Schedule

2日(火)	9/2(火)					
	9:00-12:00		13:00-18:00			
A 会場 D203			Magnetic Recording Media	Hybrid Recording Media I	Hybrid Recording Media II	
			13:00~14:15	14:30 ~ 15:45	16:00 ~ 17:15	
256席			A. Tsukamo(Nihon Univ.)	T. Kanbe (SEL)	M. Ohtake(Chuo Univ.)	
B 会場 D205	Rare Earth Magnet I	Rare Earth Magnet II	Symposium"Frontier of permanent magnetic materials for energy-efficient motors" -MSJ, MagHEM and ESICMM joint symposium-			
	9:15~10:30	10:45~12:00	13:30~15:00 15:15~17:15			
256席	R. Goto (Tohoku Univ.)	H. Kato (Yamagata Univ.)	K. Ozaki(AIST) M. Matsuura(Tohoku Univ.)			
C 会場 D201		Material Characterization	Multiferroics and Simulation	Magneto-optics I	Magneto-optics II	
		10:45~12:00	13:30~14:45	15:00~16:15	16:30 ~ 17:45	
150席		X. Liu (Shinshu Univ.)	H. Takagi (Toyohashi Univ. Tech.)	A. Yamaguchi (Univ. of Hyogo)	K. Nakagawa (Nihon Univ.)	
D 会場 D202	Spintronics Films	Heusler Films	Spin Current	Spin Wave/Fast Response	Spin Torque	
	9:45~10:45	11:00~12:00	13:00~14:00	14:15~15:30	15:45 ~ 16:45	
150席	S. Mizukami (Tohoku Univ.)	Y. Sakuraba (NIMS)	S. Kasai(NIMS)	K. Yamada (UEC)	S. Fukami (Tohoku Univ.)	
E 会場 D311	Soft Magnetic Materials I (Ferrite/High Frequency)	Soft Magnetic Materials II (Metals)	Nanoparticle/Granular I	Nanoparticle/Granular II	Fabrication Process	
	9:00~10:15	10:30~12:00	13:30~14:30	14:45 ~ 15:45	16:00 ~ 17:15	
110席	H. Taguchi(TDK)	S. Ohnuma (DENJIKEN)	T. Ogawa (Tohoku Univ.)	B. Jeyadevan(Univ. Shiga Pref.)	M. Jimbo (Daido Univ.)	
F 会場 D308	Magnetic Field Analysis	Wireless Power Transfer	Magnetic Shield/ Biomagnetic Measurements	Medical Magnetic Beads	Medical Treatments I	
	9:45 ~ 10:45	11:00~12:00	13:00~14:00	14:15 ~ 15:30	15:45 ~ 17:00	
110席	T. Sato (Shinshu Univ.)	I. Sasada (Kyushu Univ.)	T. Sasayama(Kyushu Univ.)	T. Nakagawa (Osaka Univ.)	Y. Kitamoto (Tokyo Inst. Tech.)	

3日(水)	9/3(水)				
	9:00-	12:00	13:00-18:00		
A 会場 D203	Microwave Assisted Recording	Heat Assisted Magnetic Recording	Bit Patterned Media		
	10:00~11:00	11:15~12:30	13:30~14:30		
256席	T. Kato (Nagoya Univ.)	A. Sugiyama (Waseda Univ.)	N. Honda (Tohoku Inst. Tech.)		
B 会場 D205	Sympos	ium "Spin manipulation usir	ng light"		
	10:00	~ 12:00	13:00~14:30		
256席	H. Awano(Toyo	ota Tech. Inst.)	H.Takagi(Toyohashi Univ. Tech.)	Presentation of Prize & Special Lecture	
C 会場 D201	Rare Earth Magnet III	Rare Earth Magnet IV	Rare Earth Magnet V	14:45~	
	9:15~10:30	10:45~12:00	13:00~14:30	Reception Party	
150席	S. Okamoto (Tohoku Univ.)	M. Takezawa (Kyushu Inst. Tech.)	H. Hirosawa (NIMS)	18:00~	
D 会場 D202	High-Frequency Device I	High-Frequency Device II	Magnetic Measurement		
	9:30~10:45	11:00~12:00	13:15~14:30		
150席	S. Hashi (Tohoku Univ.)	S. Yabukami(Tohoku Gakuin Univ.)	Y. Endo (Tohoku Univ.)		
E 会場 D311	Nano-Structure I	Nano-Structure II	Thin Film I		
	9:30~10:30	10:45~11:45	13:00~14:30		
110席	N. Hosoito (NAIST)	S. Nakagawa (Tokyo Inst. Tech.)	T. Nagahama (Hokkaido Univ.)		
F 会場 D308	Power Magnetics I	Power Magnetics II	Power Magnetics III		
	9:15~10:30	10:45 ~ 12:00	13:00~14:30		
110席	T. Honda (Kyushu Inst. Tech.)	S. Yamada (Kanazawa Univ.)	T. Takura (Tohoku Inst. Tech.)		

4日(木)		9/4(木)				
	9:00-12:00			13:00-18:00		
A 会場 D203	Magnetic Recording Head	Magnetic Recording Simulation	Order of Cultural Merit 2013 and	Magnetic Force Microscopy I Magnetic Force Microsco		Microscopy II
	9:30~10:30	10:45 ~ 11:45	Benjamin Franklin Medal 2014	14:30~16:00 16:15~17:45		~ 17:45
256席	R. Sugita (Ibaraki Univ.)	S. Greaves (Tohoku Univ.)	Commemorative Lecture	H. Nomura (Osaka Univ.) N. Kikuchi (Tohoku Univ.)		ohoku Univ.)
B 会場	Symposium "Energy magnetics improving motor		Dr. S. Iwasaki	Symposium "Energy magnetics improving motor		
D205	effici	ency"	13:00~14:00	efficiency"		
	9:00~10:00	10:15~12:15	Room A(D203)	14:15 ~ 15:45	16:00	~ 17:45
256席	H. Fukunaga(Nagasaki Univ.)	Y. Kaneko(TOYOTA Central R&D Labs.)		K. Ohmori(JABM) K. Fujisaki(Toyota Tech. Inst		ota Tech. Inst.)
C 会場 D201				Magnetization Process and Magnetic Domain	Magneti	c Order
				14:15~16:00 16:15~18:00		~ 18:00
150席				Y. Kamihara (Keio Univ.)	K. Yamaguchi(F	ukushima Univ.)
D 会場 D202	Spin Injection into Semi- conductors	AMR		Heusler Device	MRAM	MTJ 17:00~17:45
	9:30~11:00	11:15~12:00		14:15 ~ 15:30	15:45~16:45	H. Tanigawa
150席	T. Ochiai (Toshiba)	T. Kubota (Tohoku Univ.)		Y. Takamura (Tokyo Inst. Tech.)	H. Sukegawa (NIMS)	(RSMC)
E 会場 D311	Thin Film II	Thin Film Ⅲ		Thin Film IV Thin Film V		ilm V
	9:00~10:15	10:30~12:00		14:15~15:45 16:00~17:30		~ 17:30
110席	Y. Yasukawa (Chiba Inst. Tech.)	K. Shintaku(AIT)		S. Saito (Tohoku Univ.) S. Ishio (Akita Univ.)		kita Univ.)
F 会場 D308	Medical Treatments II	Hyperthermia		Symposium "Creation of novel materials and new analytical system using external magnetic field"		
	9:00~10:30	10:45~12:15		14:15 ~ 15:45	16:00~	~17:30
110席	H. Mamiya(NIMS)	T. Yoshida (Kyushu Univ.)		R. Aogaki(Politechnic Univ.)	M. Tanal	ka(AIST)

5日(金)	9/5(金)				
	9:00-12:00		13:00-18:00		
A 会場 D203	Symposium "Nano spin conversion science"				
256席	9:00∼10:00 T. Ono(Kyoto Univ.)	10:15~11:45 Y. Saito(Toshiba)			
B 会場 D205		Magnets and Processing			
256席		10∶00∼11∶15 M. Sahashi(Tohoku Univ.)			
C 会場 D201	Magnetic Anisotropy and Magneto-Striction I	Magnetic Anisotropy and Magneto-Striction II			
150席	9:00 ~10:30 E. Kita(Univ. of Tsukuba)	10:45∼12:15 A. Agui(JAEA)			
D 会場 D202	Sensor I	Sensor II			
150席	9:15~10:30 O. Ishii(Yamagata Univ.)	10:45∼12:00 T. Uchiyama(Nagoya Univ.)			
E 会場 D311	Surface/Interface Magnetism	Exchange Bias			
	9:30~10:45	11:00~12:15			
110席	T. Nozaki (Tohoku Univ.)	Y. Shiratsuchi (Osaka			
F 会場					
D308					
110席					

替助会員 名簿 (50音順)

愛知製鋼(株)

アルプス電気(株)

インターメタリックス(株)

(株)HGSTジャパン

NECトーキン(株)

LG Electronics

(株)エルフ

オリンパス(株)

(独)科学技術振興機構

キヤノン(株)

キヤノンアネルバ(株)

キヤノン電子(株)

喬智電子股有限公司

Crimson Interactive Pvt., Ltd.

国立印刷局研究所

昭和電工エレクトロニクス(株)

信越化学工業(株)

新日鐵住金(株)

住友金属鉱山(株)

ソニー(株)

大同特殊鋼(株)

(株)ダイヘン

タカノ(株)

田中貴金属工業(株)

(株)玉川製作所

TAILWIND INDUSTRIAL HOLDING

CO., LTD.

デクセリアルズ(株)

TDK(株)

(株)東栄科学産業

東英工業(株)

東京工業大学附属図書館

東光(株) 埼玉事業所

(株)東芝

(株)東設

東ソー(株) 東北電力(株)

東北特殊鋼(株)

(株)東陽テクニカ

DOWAエレクトロニクス(株)

戸田工業(株)

特許庁

トヨタ自動車(株)

(株)豊田中央研究所

日亜化学工業(株)

日本カンタム・デザイン(株)

日本ケミコン(株)

(独)日本原子力研究開発機構

日本電気(株)

日本放送協会

(株)二六製作所

ネオアーク(株)

パナソニック(株)

浜松光電(株)

日立金属(株)磁性材料カンパニー

日立金属(株)

(株)日立製作所

日立マクセル(株) 開発本部

富士電機(株)

富士フイルム(株)

(独)物質・材料研究機構

Prolific Technology Inc.

(株)マキタ

(株)マグネスケール

マグネデザイン(株)

(株)マコメ研究所

三菱電機(株)

三菱マテリアル(株)

ミツミ電機(株)

ミネベア(株)

(株)村田製作所

(株)リガク

理研電子(株)

(株)リコー

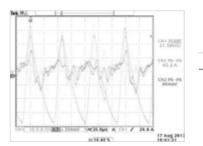
凌和電子(株)

(2014.7.8現在)

短パルス・高周波磁場測定に特化したホール素子式ガウスメーター



測定例:電磁調理器の漏れ磁場測定



---- 発生磁場 20mT/DIV

コイル電流 10A/DIV

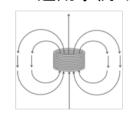
測定波形

ホール素子磁気センサーの特徴

- •磁場発生源のベクトル方向を正確に検出••• 他方式のセンサーにない高い指向性がホール素子の特徴です。
- ・極小エリアの磁場を正確に検出・・・・・・・・・・・・・・・検出部面積30×30umピンポイント測定に適しています。
- ・高いダイナミックレンジ・・・・・・・・・・・・数mT~数T高磁場領域までの高いリニアリティーを実現。

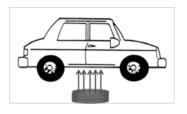
従来の高周波磁場測定の問題点である誘導ノイズ起因の誤測定を大幅に改善したガウスメーターです。

適用事例・測定のご提案









着磁パルス磁場

誘導加熱

モーター、トランスの漏洩磁場

非接触給電

3次元磁場測定装置と受託測定のご提案

- •理論計算と実測の一致を目指しています。••••• センサーと測定座標の整合性評価を行います。
- ・測定の再現性を重視しています。・・・・・・・・・・ センサーギャップ調整を自動化。
- •専門的な見地で受託測定及びレポートを作成・・・・ トレーサビリティに対応しています。









ガウスメーターメーカーだから出来る正確な磁界分布測定を 一度お試しください。

ガウスメーター製造:株式会社エーデーエス 本社:〒158-0082 東京都世田谷区等々力6-13-10-602 TEL03-3705-7261 FAX 03-3705-7263 Fmail: ads@ad -s co in

Email: ads@ad -s.co.jp HP: http://www.ad -s.co.jp システム製造・販売:有限会社パワーテック 本社:〒430-0802 静岡県浜松市東区将監町38-6 TEL053-463-8380 FAX 053401-7881 Email:<u>info@powertech.jp</u>

Email: info@powertech.jp HP: http://www.powertech.jp



Technology Communication 磁気物性の研究開発・産業分野にジャストフィットなンリューションをクリエイト。 東栄科学産業は開発型装置メーカーとして新しい技術にチャレンジしています。

TOEIS

3次元空間磁界プロファイリング

感受幅約20μの 1.5mm角3軸センサーで センシングし空間磁界を 正確にプロットできます。

永久磁石、磁気センサー、 モーター、磁気回路等 多種多様な用途で 使用できます。



振動試料型磁力計 VSM

VSM新発想 VSMとPC端末を USBでつなぐ。 まさにシンプル& パーソナル。

従来の装置に比べ、 設置面積は約1/6* 総重量も約1/10*と 大幅な小型化に 成功しました。

しかも高機能、低価格を 実現させています。 (※いずれも当社比)



非磁性全方位プローバ-

面内磁界および垂直磁界プローバ-





磁気抵抗測定装置、 TMR評価装置、 半導体用プローバー、 非磁性オートプローバー、 非磁性セミオートプローバー、 非磁性マニュアルプローバー、 非磁性高周波プローバー、 高周波プローブカード、 非磁性プローブカード









低残留磁界電磁石 電磁石 へルムホルツコイル、ソレノイドコイル、ワイス型電磁石、W3ーク型電磁石、 ビッター型電磁石、ギャップ可変型電磁石、光学用コイル、ヘッドコイル、その他

ホール効果測定装置、着磁脱磁処理装置、ガウスメーター

e-mail gijutsu@toei-tc.co.jp/

現代講座・磁気工学

【各巻A5判・上製本】



本シリーズは、学部上級生から修士・ 若手技術者を主対象に, 磁気工学にお ける新機軸の研究対象と基礎的要素を 結びつける教科書として企画・刊行。

回磁気工字入門 —磁気の初歩と単位の理解のために— 高梨弘毅著・・・・・・・・・・・・・・・・・132頁・本体2,800円
2磁気工学の解析法 三俣千春著・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
国スピントロニクス ―基礎編― 井上順一郎・伊藤博介著・・・・・・・・296頁・本体3,600円
4 スピントロニクス 一応用編一 鈴木義茂・湯浅新治・久保田 均著·····・続 刊

【各巻A5判・上製本】



本シリーズは磁気工学の基礎理論から 最先端まで幅広い分野からテーマを集 め, 境界領域も含めて様々な研究分野 に寄与する磁気の参考書として編纂。

①磁気の付随現象とその応用 井上光輝著・・・・

2磁性の電子論 日本磁気学会『平成25年度出版賞』受賞 ………356頁・本体5,000円

図 反強磁性体 -応用への展開-

深道和明著…………………344頁,本体5.000円

④垂直磁気記録

⑤電磁気学応用

岩崎俊一・中村慶久・大内一弘・村岡裕明・青井 基著・・・・・続 刊

グネティクス・イントロダクション 全5巻 【各巻A5判・並製本】



本シリーズは磁気の初学者とその周辺 領域の読者を対象に, 磁気の基礎の基 礎から興味深い磁気現象や最先端の研 究・技術まで、やさしく正確に解説。

■磁気工学超入門	―ようこそ,	まぐねの国へ―
佐藤勝昭著・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		···168頁·本体2,500円

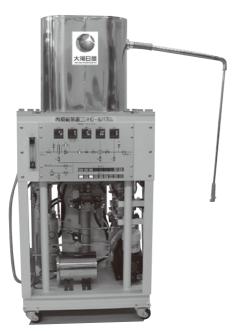
- ②メタマテリアル 一光と磁気の不思議な関係一 冨田知志他著・
- ③物質の中の磁気と光

④環境保全に貢献する高磁場技術

⑤さまざまなところで活躍する磁気センサ

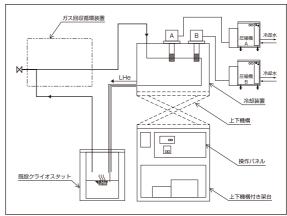


ヘリウム再凝縮装置 TRGシリーズ



- ●液体ヘリウム節約
- ●トランスファー操作不要
- ●既存クライオスタット取付可能

〈フロー図〉



〈装着例〉



〈仕 様〉

形式	TRG-375DS TRG-340DS		
再凝縮能力	18L/day	10L∕day	
ユーティリティー	電力容量:24kVA 冷却水:14L/min以上		
設置スペース	2,200(W)×2,300(D)×2,500(H)		
定期メンテナンス	冷凍機ユニット 10,000時間 圧縮機ユニット 30,000時間 ドライポンプ 10,000時間		

お問い合わせ

大陽日酸株式会社 產業ガス事業本部 特販事業部

〒142-8558 東京都品川区小山1-3-26 東洋Bldg.

TEL:03-5788-8610 URL http://www.tn-sanso.co.jp E-mail U04200@tn-sanso.co.jp



無冷媒型超電導電磁石

- 液体へリウムを使用しない4K GM冷凍装置の採用により、操作は極めて簡単です。
- ソレノイドタイプ、スプリットペア(ヘルムホルツコイル)タイプご希望の仕様に合せまして、 特殊品の設計・製作を行います。



ソレノイドコイル型 小型超雷導雷磁石

≪特 徴≫

* 軽量、コンパクトで設置場所を選びません。

* 奥行き200mmと大変スリムで、光学測定に最適です。

≪仕 様≫

*コ イ ル : ソレノイドコイル

*発生磁界 : 5T

*均 一 度 : 0.1%/10mmDSV *室温ボア径: φ50.8mm(2インチ)

流 : 100A *励磁速度 : 5T/10分

*冷 凍 機 : 0.4W GM冷凍機

法 : W280mm×D200mm×H590mm(冷凍機除く) *寸

*重 量 : 約60kg

≪仕 様≫

*コイル : スプリットペア(ヘルムホルツコイル)

*発生磁界

*均一度 : 0.1%/10mmDSV

*室温ボア径 : Φ50mm *電 流 : 96A

*冷凍機 : 1.5W GM冷凍機

*寸 法 : Φ835mm×H500mm(冷凍機、突起部除く)

*オプション装置

GP-IBコンピュータコントロール回転台付き上下動台車

〈システム参考写真〉

磁気シールドルーム内、 超電導電磁石式 振動試料型磁力計併用型 磁気異方性トルク計システム





手前:VSM 奥:トルク計

7.5T ソレノイドコイル型

超電導電磁石式振動試料型磁力計



◎ 受託測定 磁性材料のサンプル測定も行って おります。社内に各種システム製品 を常設しておりますので、当社製品 の評価用として、是非一度お問合せ ください。 また、詳細はホームページをご覧くだ さい。

主な営業品目

/〒982-0014 仙台市太白区大野田3丁目10番19号 電話 022(247) 5671(代) FAX 022(249) 3648

デジタル技術で直接描画をリードする

マスクレス露光装置

D-light DL-1000 Series





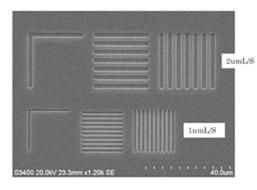
空間光変調器 DMD (Digital Micromirror Device)を用いたパターン縮小投影技術で、最小画素 1 μm にて自由度の高いパターン描画を実現。

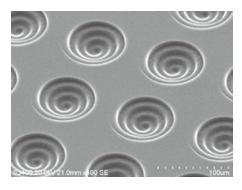
数ミリ角の微小基板上のターゲットに対して、位置を確認しながら電極パターンを投影することができます。

また、レジストの精密三次元加工が行えるグレースケール露光機能は市場の新たなニーズにお応えします。

ナノエレクトロニクス・半導体・MEMS・ μ TAS などの研究開発分野に加え精密転写用型の試作、少量多品種のデバイス製造へと応用が広がります。

DL-1000 シリーズは圧倒的なパフォーマンスで直接描画をリードします。





Nano System Solutions http://www.nanosystem-solutions.com

株式会社ナノシステムソリューションズ

■技術センター:〒206-0811 東京都稲城市押立 1033-4 TEL: 042-401-6284 FAX: 042-401-6289